

VF-P003

OLED 제조설비용 진공밸브 기술 관련 특허 동향 분석

박찬우¹, 정경수, 김영철, 백인경, 이승률²

¹기계융복합기술연구조합, ²서강대학교 기술경영전문대학원

타 디스플레이의 역사에 비하여 상대적으로 짧은 기간 내 빠른 기술적인 성장을 거듭한 OLED 기술은 향후 디스플레이는 물론 조명시장까지 잠재적인 큰 시장을 갖고 있다. 따라서 이러한 시장을 확보하기 위해서 지속적인 기술 개발이 필요한 실정이다. 본 논문에서는 OLED 제조공정 중 챔버를 진공상태로 유지하기 위해 챔버 단독 또는 챔버와 챔버 사이에 설치되는 진공밸브 관련 기술의 특허 현황분석을 통해 중복연구와 기술 침해로 인한 문제점을 미연에 방지하고 향후 연구방향을 설정하는데 있어 선행 기술 자료로 활용하고자 한다.

Keywords: OLED display fabrication equipment (OLED 디스플레이제조장비), thin film process chamber (박막공정 챔버), vacuum valve (진공밸브), patent Application (특허출원)